PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2002359402 A

(43) Date of publication of application: 13.12.02

(51) Int. CI

H01L 33/00 H01L 21/28 H01L 21/3205 H01L 27/15

(21) Application number: 2002093914

(22) Date of filing: 29.03.02

(30) Priority:

29.03.01 US 2001 823824

(71) Applicant:

LUMILEDS LIGHTING US LLC

(72) Inventor:

COLLINS WILLIAM DAVID III BHAT JEROME CHANDRA STEIGERWALD DANIEL

ALEXANDER

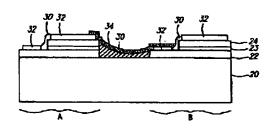
(54) MONOLITHIC SERIES/PARALLEL LED ARRAY FORMED ON HIGHLY RESISTIVE SUBSTRATE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a light-emitting device array formed on a highly resistive substrate.

SOLUTION: A series/parallel LED array is so formed on a highly resistive base layer that p- and n-contacts for array are positioned on the same surface of the array. Individual LEDs are separated, electrically, from each other by a trench or ion implantation. An internal connect deposited on the array is connected to the contact of individual LED in the array. In some embodiments, the LED is a III nitride device formed on a sapphire base layer. In one implementation, two LEDs formed on a single base layer are connected in monolithic electrostatic antiparallel, to form a discharge protection circuit. In one implementation, multiple LEDs formed on a single base layer are connected in series. In one implementation, multiple LEDs formed on a single base layer are connected in parallel. In various implementations, a phosphor layer covers a part of a base layer, where one or more individual LEDs are formed.

COPYRIGHT: (C)2003,JPO



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-359402 (P2002-359402A)

(43)公開日 平成14年12月13日(2002.12.13)

(51) Int.Cl.7		識別記号	j	FI		5	·-7] (参考)
H01L	33/00	•	. H	01L	33/00	E	4M104
	21/28	301			21/28	301B	5 F O 3 3
	21/3205				27/15	Z	5 F 0 4 1
	27/15				21/88	В	

審査請求 未請求 諸求項の数20 〇1. (全 9 頁)

		数 登爾米	未開水 耐水坝の数20 OL (全 9 貝)
(21)出願番号	特顧2002-93914(P2002-93914)	(71)出顧人	500507009
			ルミレッズ ライティング ユーエス リ
(22)出顧日	平成14年3月29日(2002.3.29)		ミテッドライアビリティ カンパニー
			アメリカ合衆国 カリフォルニア州
(31)優先権主張番号	09/823824		95131 サン ホセ ウェスト トリンプ
(32)優先日	平成13年3月29日(2001.3.29)		ル ロード 370
(33)優先権主張国	*国 (US)	(72)発明者	ウィリアム ディヴィッド コリンズ ザ
			サード
		Ì	アメリカ合衆国 カリフォルニア州
			95127 サン ホセ ケイレン ドライヴ
		1	3435
		(74)代理人	100059959
		(1.2)(4.2)	弁理士 中村 稔 (外9名)
	•		最終頁に続く

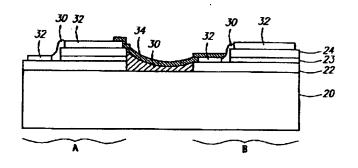
(54) 【発明の名称】 高抵抗性基層の上に形成されたモノリシック直列/並列LEDアレイ

(57)【要約】

【課題】 高抵抗性基層に形成される発光デバイス アレイを提供すること。

【解決手段】 アレイ用のp及びn型コンタクトが該ア

レイの同一面に位置するよう直列/並列LEDアレイが高抵抗性基層上に形成される。個別LEDはトレンチ又はイオン注入で電気的に互いに分離される。アレイに堆積させた内部コネクトはアレイにおける個別LEDのコンタクトに接続する。様々の実施形態ではLEDはサファイア基層上に形成されたII族窒化物デバイスである。一実施形態では、単一の基層上に形成された2つのLEDは逆並列接続され、モノリシック静電放電保護回路を形成する。一実施形態では単一の基層に形成された多数のLEDは直列接続される。一実施形態では単一の基層上に形成された多数のLEDは並列接続される。様々な実施形態では、蛍光体層が、1以上の個別LEDが形成される基層の一部を覆う。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 高抵抗性基層の上に形成された発光デバイスアレイであって、

前記基層の第1部分の上に形成された第1n型層と、該第1n型層の上に形成された第1活性領域と、該第1活性領域の上に形成された第1p型層と、前記第1n型層に接続された第1n型コンタクトと、前記第1p型層に接続された第1p型コンタクトと、を備えた第1発光デバイスであって、前記第1n型コンタクトおよび前記第1p型コンタクトが該デバイスの同一面に形成される第1発光デバイスと、

前記基層の第2部分の上に形成された第2n型層と、該第2n型層の上に形成された第2活性領域と、該第2活性領域の上に形成された第2p型層と、前記第2n型層に接続された第2n型コンタクトと、前記第2p型層に接続された第2p型コンタクトと、を備えた第2発光デバイスであって、前記第2n型コンタクトおよび前記第2p型コンタクトが該デバイスの同一面に形成される第2発光デバイスと、

前記第1発光デバイスと前記第2発光デバイスとを分離する、トレンチおよびイオン注入領域のうちの一方と、前記第1n型コンタクトおよび前記第1p型コンタクトのうちの一方を、前記第2n型コンタクトおよび前記第2p型コンタクトのうちの一方に接続する、第1内部コネクトと、を具備することを特徴とするアレイ。

【請求項2】 前記第1および第2n型層、前記第1および第2活性領域、ならびに、前記第1および第2p型層は、III族窒化物層を含むことを特徴とする請求項1に記載のアレイ。

【請求項3】 前記基層は、サファイア、SiCおよび 30 III族窒化物材料を含む群より選択されることを特徴と する請求項1に記載のアレイ。

【請求項4】 前記第2p型コンタクトを前記第1n型 コンタクトに接続する第2内部コネクトを具備し、

前記第1内部コネクトは、前記第1p型コンタクトを前記第2n型コンタクトに接続することを特徴とする請求項1に記載のアレイ。

【請求項5】 前記第1および第2内部コネクトの一部 の下にある誘電体層を具備することを特徴とする請求項 4に記載のアレイ。

【請求項6】 前記第1発光デバイスおよび前記第2発 光デバイスは直列接続される請求項1に記載のアレイ。

【請求項7】 前記第1発光デバイスおよび前記第2発 光デバイスは並列接続される請求項1に記載のアレイ。

【請求項8】 前記第1n型層とは逆の側にある前記基層の前記第1部分の表面を覆う蛍光体層を具備することを特徴とする請求項1に記載のアレイ。

【請求項9】 前記第1n型層および前記第2n型層の下にあり、かつ、前記トレンチの底面を形成する高抵抗性層を具備することを特徴とする請求項1に記載のアレ

イ。

【請求項10】 前記基層の第3部分の上に形成された第3n型層と、該第3n型層の上に形成された第3活性領域と、該第3活性領域の上に形成された第3p型層と、前記第3n型層に接続された第3n型コンタクトと、前記第3p型層に接続された第3p型コンタクトとを備えた第3発光デバイスであって、前記第3n型コンタクトおよび前記第3p型コンタクトが該デバイスの同一面に形成される第3発光デバイスと、

10 前記基層の第4部分の上に形成された第4n型層と、該第4n型層の上に形成された第4活性領域と、該第4活性領域の上に形成された第4p型層と、前記第4n型層に接続された第4n型コンタクトと、前記第4p型層に接続された第4p型コンタクトとを備えた第4発光デバイスであって、前記第4n型コンタクトおよび前記第4p型コンタクトが該デバイスの同一面に形成される第4発光デバイスと、

前記第1 n型コンタクトを前記第3 p型コンタクトに接続する第2内部コネクトと、

20 前記第2n型コンタクトを前記第4p型コンタクトに接続する第3内部コネクトと、

前記第3 n型コンタクトを前記第4 n型コンタクトに接続する第4内部コネクトと、を具備し、

トレンチおよびイオン注入領域のうちの一方が、前記第 1、第2、第3および第4発光デバイスを互いに分離 1.

前記第1内部コネクトが前記第1p型コンタクトを前記 第2p型コンタクトに接続することを特徴とする請求項 1に記載のアレイ。

30 【請求項11】 高抵抗性基層の上に形成されたIII族 窒化物発光デバイスのアレイであって、

前記基層の上に形成された第1伝導型層と、

該第1伝導型層の上に形成された複数の活性領域であって、該複数の活性領域のそれぞれの下にあるエリアが前記第1伝導型層の一部により囲まれ、かつ、前記第1伝導型層の部分が前記複数の活性領域における各活性領域の下にあるエリアを間に挟むように設けられた、複数の活性領域と、

該複数の活性領域の上に設けられた複数の第2伝導型層 40 と、

前記第1伝導型層に接続された第1コンタクトと、 前記複数の第2伝導型層に接続された複数の第2コンタ クトと、を具備することを特徴とするアレイ。

【請求項12】 前記第1コンタクトは、前記複数の活 性領域における各活性領域の下にあるエリアを囲むこと を特徴とする請求項11に記載のアレイ。

【請求項13】 前記第1伝導型層は、Siを用いてドーピングされたGaNを含むことを特徴とする請求項1 1に記載のアレイ。

50 【請求項14】 前記複数の第2伝導型層は、Mgを用

(3)

20

30

3

いてドーピングされたAIGaNを含むことを特徴とす。 る請求項11に記載のアレイ。

【請求項15】 前記複数の第2コンタクトは銀を含む "ことを特徴とする請求項11に記載のアレイ。

【請求項16】 前記第1コンタクトはA1を含むことを特徴とする請求項11に記載のアレイ。

【請求項17】 前記第1コンタクトはAgを含むことを特徴とする請求項11に記載のアレイ。

【請求項18】 前記基層は、サファイア、SiCおよびIII族窒化物材料を含む群より選択されることを特徴とする請求項11に記載のアレイ。

【請求項19】 前記複数の活性領域の1つの下にある 前記基層の表面の一部を覆う蛍光体層を具備し、

前記表面が前記第1伝導型層と逆の側にあることを特徴 とする請求項11に記載のアレイ。

【請求項20】 高抵抗性基層の上に発光デバイスアレイを形成する方法であって、

前記基層の上にn型層を形成する工程と、

前記n型層の上に活性領域を形成する工程と、

前記活性領域の上にp型層を形成する工程と、

前記n型層、前記活性領域および前記p型層の一部をエッチングにより除去して、第1デバイスと第2デバイスとを分離するトレンチを形成する工程と、

前記p型層ならびに前記第1および第2デバイスのそれ ぞれの上の前記活性領域の一部をエッチングにより除去 して、前記n型層の一部を露光する工程と、

前記第1および第2デバイスの前記p型層の上に第1および第2p型コンタクトを設ける工程と、

前記第1および第2デバイスの前記n型層の上に第1および第2n型コンタクトを設ける工程と、

前記第1 n型コンタクトおよび前記第1 p型コンタクトの一方を前記第2 n型コンタクトおよび前記第2 p型コンタクトの一方に接続する、内部コネクトを堆積させる工程と、を具備することを特徴とする方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【従来の技術】GaAsのような従来の発光ダイオード (LED) 材料は、モノリシックで製作された際、単一接合 (single junction) または多重並列接合 (multiple e parallel junction)を有する構造をもたらしてき 40 た。図1Aは、典型的な多重並列接合LEDアレイ10を示す。共通のn型領域の上に数個のp型領域13を成長させる。n型コンタクトはn型領域18に接続し、数個のp型コンタクト14はp型領域13に接続する。このデバイスは、n型領域18を基層12の上に形成した後このn型領域の上に連続的なp型層を形成することにより、製作される。この後、p型領域13間にトレンチ15を機械的に切削することによりまたは化学的にエッチングすることにより、p型層は、別個の領域に分割される。図1Bは、別の多重並列接合LEDアレイ16を50

示す。機械的に切削 (sawing) することまたは化学的に エッチングすることに代えて、p型領域13は、拡散 (diffusion) により電気的に互いに分離される。 【0002】

【発明が解決しようとする課題】デバイスの両面にコンタクトを用いる場合には1つの共通した伝導層、すなわち、n型層またはp型層が必要となるので、図1Aおよび図1Bに示したモノリシック(monolithic)アレイは、図2に示す並列構成に限定される。

[0003]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、直列ま たは並列LEDアレイは、このアレイのためのp型コン タクトおよびn型コンタクトがともに、このアレイにお ける同一面に存在するように、絶縁基層または高抵抗性 基層に形成される。個別のLED(個別LED)は、ト レンチによりまたはイオン注入 (ion implantation) に より、互いに電気的に分離される。アレイ上に堆積させ た内部コネクト(interconnect)は、アレイにおける個 別LEDのコンタクトと接続する。いくつかの実施形態 では、LEDはサファイア基層の上に形成されるIII族 窒化物デバイスである。一実施形態では、Ⅲ族窒化物 デバイスは、高抵抗性のSiCまたはIII族窒化物の基 層の上に形成される。一実施形態では、単一基層の上に 形成された2つのLEDは、逆並列で接続されて、モノ リシック静電放電保護回路を形成する。一実施形態で は、単一基層の上に形成された多数のLEDは直列に接 続される。直列アレイは、同一エリアを占める単一LE Dに比べて、より高い電圧で動作しうるので、電源デザ インを簡素化することができる。一実施形態では、単一 の基層に形成した多数のLEDは、並列に接続される。 この実施形態では、n型領域が、p型領域のそれぞれを 囲みかつこれらp型領域を間に挟むように、多数のp型 領域が単一のn型領域に形成される。いくつかの実施形 態では、蛍光体層が、1つ以上の個別LEDが形成され る基層の一部を覆う。

[0004]

【発明の実施の形態】可視スペクトル全域での動作が可能である高輝度発光ダイオード(LED)の製造において現在関心が持たれている材料システムは、III-V族半導体、特にIII族窒化物材料ともよばれるガリウム、アルミニウム、インジウムおよび窒素の二元合金、三元合金および四元合金である。本明細書で引用するIII族半導体層は、一般式AlxGayIn1-x-yN(0≤x≤1、0≤y≤1、0≤x+y≤1)により表現される化合物であり、この化合物は、さらにホウ素およびタリウムのようなあるIII族の元素を含み、この化合物では窒素のいくつかを、リン、砒素またはアンチモンで置き換えることができる。一般的には、有機金属化学気相成長法(MOCVD)、分子線エピタキシー(MBE)またはその他のエピタキシャル技術によって、サファイア、

炭化珪素または窒化ガリウムの基層の上に、川族窒化・ 物デバイスを成長させる。その広範な有用性(availabi lity)および使い易さから、サファイアの基層が用いら れることが多い。サファイアは絶縁体である。Kramesら の発明について、1999年12月22日に出願され 「増大した光生成性能を有するIII族窒化物発光デバイ ス ("III-Nitride Light Emitting Device with Increa sed Light Generating Capability") 」と題された特許 出願第09/469,657号は、低い光学吸収を有す る高屈折率の基層上にIII族窒化物発光デバイスを成長 させることを開示している。なお、この特許出願の内容 は、引用により本明細書に含められる。これらの基層に ついては、炭化珪素(SiC)または川族窒化物材料 とすることができ、これらの基層は、その低い不純物含 有量に起因して高い電気的抵抗を有する。絶縁性基層ま たは高抵抗性基層上に成長させたIII族窒化物デバイス は、該デバイスにおける同一面上にエピタキシャル成長 させた半導体に対して正極および負極の電気的コンタク 小を有していなくてはならない。これに対して、図1A および図1Bに示したような伝導性の基層上に成長させ た半導体デバイスは、一般的には、一方の電気的コンタ クトをエピタキシャル成長材料上に形成し、かつ、他方 の電気的コンタクトを基層上に形成するように製作され る。

【0005】絶縁性基層または高抵抗性基層を用いれ ば、個別LED間にトレンチまたはイオン注入領域を形 成して個別LEDを電気的に分離することにより、II 族窒化物モノリシックLEDアレイを製作することがで きる。図3~図7は、本発明の一実施形態にかかる111 族窒化物モノリシックLEDの製作を示す。図3におい て、例えばSi、GeまたはOを用いてドーピングされ たGaNのn型層22が、高抵抗性の基層20に重ねて 形成される。この後、例えばInGaNの活性層23 が、n型層22に重ねて形成され、最後に、例えば2 n、Mg、Be、CaまたはCdを用いてドーピングさ れたAlGaNのp型層24が、活性層に重ねて形成さ れる。層22、23および24は、実際には、異なる組 成およびドーパント濃度を有する数個のサブ層を含みう るが、これらのサブ層については簡略化のために省略す る。n型層22は、例えば、核化層、高抵抗性のGaN 層(例えば意図せずにドーピングされたGaN層)、n 型に少なくドーピングされた層、さらに多くドーピング されたn型層を含みうる。活性層23は、例えば、多重 量子井戸構造を有しうる。

【0006】図4において、n型層22、活性層23およびp型層24の一部がエッチングにより除去されて、トレンチ26が形成される。用いるエッチングについては、例えば、BCl3のような塩素を含有する腐食液を用いた反応性イオンエッチングとすることができる。トレンチ26は、該トレンチのいずれの側にある半導体層

を電気的に分離するのに十分幅広いものである。トレンチ26は、意図せずにドーピングされたGaN層のような n型層 22の下にある基層または高抵抗性の層にまで、エッチングされる。同様に、高抵抗性を有すべき介在(intervening)材料を溶かすことができるイオン注入処理を用いることにより、隣接するLEDを電気的に分離することができる。この後、残存している半導体材料の各島におけるp型層 24 および活性層 23の一部が、例えば反応性イオンエッチングを用いて図5に示すようにエッチングにより除去される。第2のエッチングによって、n型層 22の上の棚(ledge)28が露光される。最終的には、この棚にn型コンタクトが形成される。

【0007】図6を参照するに、デバイスの上に誘電体材料30を露光することにより、n型コンタクト形成のための棚が電気的に分離される。この後、誘電体がパターン化されところどころ除去されて、n型層22およびp型層24にコンタクト穴が開けられる。よって、基層上の個別LED間にあるトレンチ26、および、各LEDにおける露光されたp型層とn型層との間にあるメサ壁(mesa wall)に、誘電体30が残される。誘電体30は、例えば、珪素酸化物(oxides of silicon)、珪素窒化物(nitrides of silicon)、珪素酸窒化物(oxynitrides of silicon)、酸化アルミニウム(aluminum oxide)、または、その他任意の好適な誘電体材料とすることができる。

【0008】図7Aおよび図7Bは、完成した直列LE Dアレイの2つの例を示す。図7Aは、アレイにおける LEDがトレンチにより分離されているデバイスを示 す。図7日は、アレイにおけるLEDがイオン注入領域 301により分離されているデバイスを示す。電極材料 を堆積しパターン化して、p型およびn型コンタクト3 2が形成される。 n型コンタクトのための典型的なコン タクト材料はAlまたはTi-Alであり、p型コンタ クトのための典型的なコンタクト材料はAg、Au、N i、Ptまたはこれらの合金である。コンタクト32に ついては、光がエピタキシャル層の表面を介して抽出さ れるデバイスにおけるもののように、透明性なものとす ることができ、または、光が基層を介して抽出されるフ リップチップデバイスにおけるもののように、反射性な ものとすることができる。コンタクトを堆積およびパタ ーン化させた後、接続されていない発光ダイオードのア レイが単一の基層上に形成される。同一の最終的構造を 作りあげるためにその他の処理フローを用いることがで きる。この後、多くの様々な配列がなされたLEDが接 続される。

【0009】この後、デバイス上における個別LEDを接続するための内部コネクト(interconnect)34を堆積させる。内部コネクト34については、例えば、A 50 I、Cu、Au、Ag、または、AISiCuのような

合金とすることができる。p型およびn型コンタクト3・2は、半導体層に対するオーミックコンタクトを形成するように最適化された材料であるが、内部コネクト34は、厚い材料であり、かつ、電流を伝えるように最適化された高伝導性の材料である。透明なコンタクトを介してデバイスから光が抽出されるのであれば、内部コネクトに吸収される光の量を最小化すべくできるだけコンタクトの障害とならないように、内部コネクトを堆積させる。図7Aおよび図7Bに示した2つのLEDは、LEDーBのn型コンタクトをLEDーAのp型コンタクトに接続するように、直列に接続される。明らかであるように、金属性の内部コネクト34については、多くの様々な配置がなされたモノリシックアレイのLEDを接続

【0010】一実施形態では、図8Aおよび図8Bに示すように、4つのLEDの直列アレイは、釣り合いのとれた正方形(balanced square)の配置となるように形成されている。図8Bは、正方形アレイにおいて直列接続された4つのLEDの回路図を示す。図8Aは、図8Bの一実施形態についての平面図を示す。製作後、アレイは、製作された後、実装アレイから光を出す光学機に実装されるので、LEDアレイの最大寸法を最小化することが望ましい。光学機は、一般的には、光源のサイズとともに幾何学的に大きくなる。

するように堆積させることができる。

【0011】図8Aに示すアレイは、図3~図7Aで上 述したような個別LED間にトレンチ80を形成するた めに111族窒化物材料を除去するためのエッチングによ り電気的に分離された、4つの直列接続されたLEDを 有する。エッチングは、意図せずにドーピングがなされ たGaN層のような、高抵抗性のIII族窒化物層にまで 少なくとも行われる。電気的な内部接続は、金属性トレ ース(trace)81により設けられる。結果として得ら れるデバイスは、図8Bに示す電子回路により表現され うる。よって、このデバイスは、同一の活性領域面積を 有する単一LEDに比べて、4倍の電圧で動作し、1/ 4の電流で動作する。例えば、1mm2のIII族窒化物L EDは、3.0V、350mAで動作することができ る。図8Aに示すような4つの直列内部接続されたLE Dに分割された、この同一の活性接合エリアによって、 デバイスは、12.0V、87.5mAで動作することが できる。このより高い電圧およびより低い電流での動作 によって、LEDアレイのための電子駆動回路がほとん ど不要となる。実際には、電子駆動回路は、より高い効 率、より高い電圧で動作しうるので、LED発光システ ムの全体的な効率を向上させることができる。本実施の 形態にかかるモノリシックデバイスは、個別LEDダイ を直列に設置する従来の手法よりも好ましい。従来の手 法では、LEDダイが占める全体面積は、ダイ設置マシ ン (die-attach machine) により必要とされる公差 (to lerance) に起因して増大する。これにより、不本意に

も、LED全体の光源サイズが増加し、ひいては、LEDシステムにおける光学機のサイズを大きくする必要がでてくる。好ましい実施形態では、電気的分離のためのトレンチエッチングまたはイオン注入によって、ダイオード同士をできるだけ近接させて配置することができる。トレンチ領域またはイオン注入領域の幅については数μm程度とすることができ、これにより、本実施形態におけるダイオードの実装密度が非常に大きくなりうる。

【0012】本発明によれば、LEDのモノリシック直 列アレイによって、いくつかの効果を得ることができ る。第1に、モノリシックアレイは、サブマウントのよ うな外部回路に対する接続数を削減する。光が透明コン タクトを介してデバイスのエピタキシャル面から抽出さ れるようにデバイスを形成すれば、外部回路に対する接 続数を削減することは、デバイスのより大きな面積から 光が抽出されうることを意味する。このようなデバイス では、LEDは、ワイヤボンドによって外部回路に接続 される。このワイヤボンドは、LEDダイから通常であ れば抽出される光を部分的に覆う。内部コネクトは、一 般的には、このように抽出される光を覆うことを著しく 最小限にまで抑える。デバイスがフリップチップであれ ば、サブマウントに対するコンタクトが非常に少ないと いうことは、このデバイスは光を生成する活性領域をよ り多く有することができるということを意味する。第2 に、上述したように、モノリシック直列アレイは、単一 の個別LEDに比べて高い電圧で動作する。動作電圧を 高くすることにより、LEDアレイを駆動する電源のデ ザインを簡略化することができる。

【0013】図9Aおよび図9Bは、釣り合いのとれた正方形(balanced square)の直列/並列LEDアレイを示す。図9Bは、直列接続された2つのLEDの2つの並列ストリングとして接続された4つのLEDについての回路図を示す。図9Aは、図9Bの一実施形態の平面図を示す。このような直列/並列アレイは、図3~図7Aを参照して上述したように形成される。

【0014】図10は、2つのダイオードが逆並列(an tiparallel)配置となるように接続された、静電放電(ESD)保護回路を示す。第1のLEDは、第2のLEDにおける反転絶縁破壊(reverse breakdown)をクランピングする。図11および図12は、モノリシックESD保護回路の一実施形態40を示す。構造Aおよび構造Bが高抵抗性基層20の上に形成される。一方の構造Bは、LEDーAにおける反転絶縁破壊をクランピングするために用いられる。p型層41aおよび41bは、活性領域49aおよび49bの上に形成され、これら活性領域49aおよび49bは、n型層42aおよび42bの上に形成される。トレンチ43は、デバイスAとデバイスBとの間に形成される。n電極45aおよ

び45bがトレンチ43を隔てて互いに向き合うよう に、n型層42aおよび42b上にコンタクトを形成す るための棚(ledge)が露光される。誘電体層47は、 p型層とn型層とを電気的に分離する。LED-Aのp 型コンタクトがクランピング (clamping) デバイスBの n型コンタクトに接続されるように、p電極44aとn 電極45bとが内部コネクト46aにより接続される。 内部コネクト46を堆積させた領域では、LED-Aの n型コンタクトは、図12に示すように、誘電体層47 によって内部コネクト46aと分離される。図11に示 すように、LED-Aのp型コンタクトとクランピング デバイスBのn型コンタクトとの間の内部コネクトは、 デバイスにおける一方の面に形成され、LED-Aのn 型コンタクトとクランピングデバイスBのp型コンタク トとの間の内部コネクトは、デバイスにおける他方の面 に形成される。この後、本構造は、はんだバンプ (bum p) またはワイヤボンドによって、サブマウントまたは その他の構造(図示しない)に接続されうる。

【0015】図11および図12は、ウランピングデバイスがLEDと同一のサイズであるような構造を示す。 クランピングデバイスは、通常の動作環境では発光しないので、クランピングデバイスのサイズについてはLE Dに関連して削減することができる。一実施形態では、 クランピングデバイスのためのp-n接合をはんだバンプまたはワイヤボンドの下に形成することができるので、有用な発光領域が失われることはない。別の実施形態では、2つの逆並列ダイオードのサイズは略等しく、かつ、交流電流源を用いてデバイスを動作させることができる。

【0016】並列LEDアレイを高抵抗性基層の上に形成することも可能である。図13および図14は、このようなアレイの一実施形態を示す。3つのp型領域90、91および92は、これらのp型領域を間に挟む単一の連続したn型領域93によって互いに分離されている。p型層24の上に堆積させたp型コンタクト32bおよびn型層22の上に堆積させたn型コンタクト32aは、はんだバンプ95によってサブマウント(図示しない)に接続する。このサブマウントは、制御回路、または、各p型領域と個別に連絡をとる適切な接続物を含むことができる。このような実施形態では、各LEDを他のLEDとは別個に動作させることができる。

【0017】n型領域が単一のp型領域の一部分を間に挟むような単一LEDが、「増大した光生成能力を有するIII族窒化物発光デバイス ("III-Nitride Light-Emit tingDevice with Increased Light Generating Capability")」と題された、Kramesらの発明について1999年12月22日出願の特許出願第09/469.657号に開示されている。Kramesらのデバイスは、図14に示すように、n型コンタクト93の上部平面部分96、および、上部にあるn型コンタクト上の2つのはんだバ 50

ンプがない。この結果、下部にある2つのn型コンタクトはんだバンプからの電流は、n型コンタクト93における垂直アーム97の最上部分には容易には広がらない。実際には、n型コンタクト材料に対する電気移動法では、かかるデバイスのn型コンタクトにおける垂直部分への電流の流れをすべて遮るかもしれない。これに対して、図14に示した対称並列接合(symmetrical para lleljunction)デバイスは、電流の流れおよび増加した重複性を実現するための方法をより多く提供する。n型コンタクトの上部平面アーム96は、垂直アーム97の上面での「行き詰まり(dead end)」を除去するので、n型コンタクト93のあらゆる部分に電流が容易に広がりうる。

【0018】図15に示すように、直列または並列いず れかのモノリシックアレイのLEDにおける1つ以上の 個別LEDを蛍光体で覆うことにより、LEDが発する 光の色を変化させることができる。フリップチップデバ イスでは、アレイにおける単一LEDが形成される基層 の一部の底面に、蛍光体コーティング100をプリント する。フリップチップデバイスの基層に蛍光体コーティ ングを付与する1つ方法が、引用することにより本明細 書に含められる、Loweryの発明について「発光ダイオー ド上のステンシル蛍光体層("Stenciling Phosphor Lay ers on Light Emitting Diodes")」と題して2000 年10月13日に出願された特許出願第09/688, 053号において、さらに詳細に記載されている。モノ リシックアレイにおけるいくつかのLEDの上に蛍光体 コーティングを付与することにより、LEDアレイは様 々な色の光を同時に生成することができる。このような アレイは、複数の色を混ぜて白色光を生成するときに有 用となりうる。選択的に蛍光体を配置して接続された、 個別に利用可能な(addressable)並列LEDを組み込 んだLEDアレイについて、色調整可能なLEDアレイ を製作することができる。

【0019】本発明の特定実施形態を説明してきたが、本発明から逸脱することなく本発明のより広い態様において変更および変形を施すことが可能であることは、当業者にとって自明であり、したがって、別記請求項は、該請求項の範囲内において、本発明の思想および範囲内に含まれるそういった変形および変更をすべて包含すべきものである。

【図面の簡単な説明】

【図1A】典型的な多重並列接合LEDアレイを示す図 【図1B】典型的な多重並列接合LEDアレイを示す図 【図2】並列LEDアレイの回路図

【図3】各製作段階における本発明にかかる直列LED の実施形態を示す図

【図4】各製作段階における本発明にかかる直列LED の実施形態を示す図

【図 5 】 各製作段階における本発明にかかる直列LED

の実施形態を示す図

【図6】各製作段階における本発明にかかる直列LEDの実施形態を示す図

【図7A】直列LEDアレイの一実施形態を示す図

【図7B】直列LEDアレイの一実施形態を示す図

【図8A】直列LEDアレイの一実施形態の平面図

【図8B】直列LEDアレイの回路図

【図9A】直列/並列LEDアレイの平面図

【図9B】直列/並列LEDアレイの回路図

【図10】1組の逆並列LEDの回路図

【図11】モノリシックESD保護構造の一実施形態の 平面図

【図12】図11に示した構造の断面を示す図

【図13】並列LEDアレイの断面を示す図

【図14】図13に示した構造の平面を示す図

【図15】個別LEDの1つを蛍光体が覆うモノリシッ

クLEDアレイを示す図

【符号の説明】

20 基層

22 n型層

2 3 活性層

24 p型層

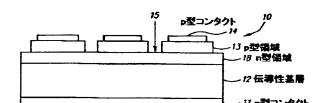
10 30 誘電体材料

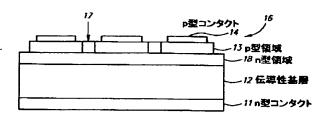
32 コンタクト

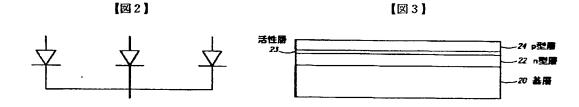
34 内部コネクト

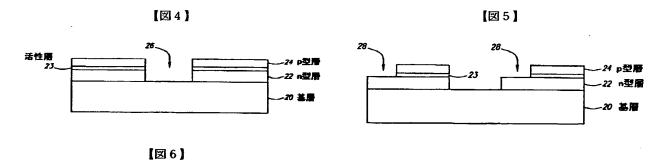
301 イオン注入領域

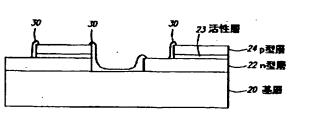
[図1A] 【図1B】

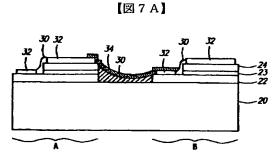


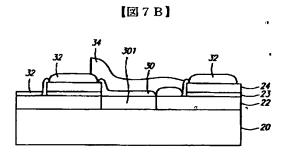


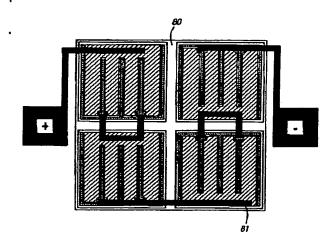




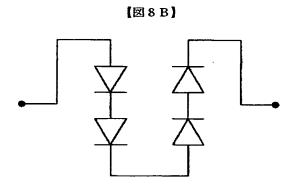


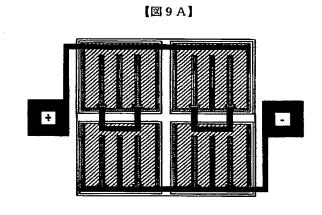


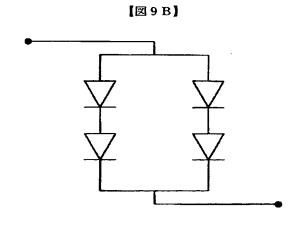


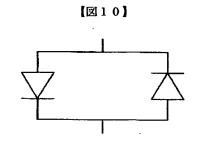


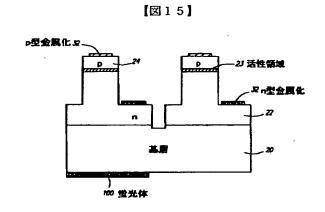
[図8A]



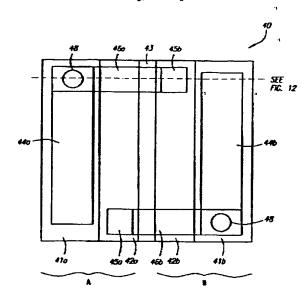




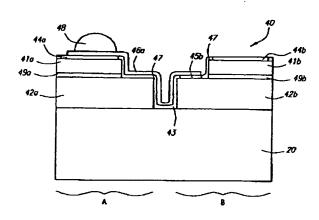




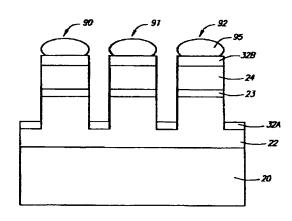
【図11】



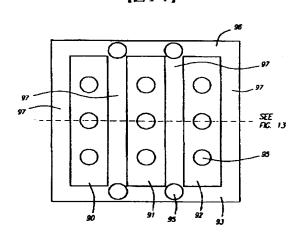
【図12】



【図13】



[図14]



フロントページの続き

(72)発明者 ジェローム チャンドラ バット アメリカ合衆国 カリフォルニア州 94131 サン フランシスコ ウォレン ドライヴ #301 470

(72)発明者 ダニエル アレクサンダー ステイガーウォルド アメリカ合衆国 カリフォルニア州 95014 クーパティーノ ロックウッド ドライヴ 10430ーピー Fターム(参考) 4M104 AA04 BB02 BB04 BB05 BB06

BB08 BB09 CC01 DD15 DD16

DD17 DD18 GG04

5F033 GG02 HH08 HH09 HH11 HH13

HH14 0009 0037 RR03 RR04

RR06 RR08 W00

5F041 AA12 AA21 AA42 CA04 CA05

CA12 CA34 CA40 CA46 CA49

CA65 CA66 CA71 CA74 CA75

CA93 CB11 CB25 CB36 EE25